

# 用于8英寸半导体与光伏基板搬运的高精度防静电PEEK晶圆真空吸笔

货号: PL-CP115



## 简介

这款高性能防静电PEEK晶圆真空吸笔专为8英寸半导体与光伏晶圆的精准搬运设计，可定制化的解决方案为关键洁净室环境与精密基板转移工序提供优异的耐化学性与机械耐用性。

## 了解更多

应用场景	说明	核心优势
晶圆检测	在光学或扫描电镜检测工位之间人工转移8英寸硅晶圆。	接触面积极小，降低产生表面缺陷的风险。
光伏电池分选	在组装与测试阶段对高效太阳能电池进行搬运与分类。	柔和真空吸附可避免产生微裂纹，维持电池效率。
湿法工艺台处理	在湿化学环境中，在化学浴与清洗工位之间转移基板。	对苛刻工艺化学品与水分具备出色耐受性。
薄膜沉积	在PVD/CVD真空腔或负载锁室中取放基板。	高热稳定性允许在高温沉积工序后直接搬运。
洁净室研发	先进材料研发机构中的通用基板搬运。	颗粒脱落量极低，维持严格ISO洁净标准。
芯片键合准备	为切割或后续芯片键合工序人工定位晶圆。	防静电性能可避免敏感微电路产生潜在缺陷。
LED基板搬运	LED芯片制造过程中对蓝宝石或碳化硅基板进行精准操作。	可稳定抓握坚硬抛光表面，不会打滑或刮伤。

参数类别	PL-CP115 规格详情
型号标识	PL-CP115 系列
主要材料	高性能防静电PEEK
基板适配性	完全可定制（适配8英寸/200mm晶圆优化）
表面电阻	可按要求定制防静电范围（例如 $10^6 - 10^9 \Omega$ ）
工作温度范围	可根据工艺要求定制
化学兼容性	通用型（对大多数酸、碱与溶剂具备高耐受性）
真空接口类型	可定制尺寸，适配工厂真空管线或便携式泵
吸头结构	可按需定制形状（平面、弧形、多点式）
洁净室等级	适配ISO 3 - 8级（依应用场景而定）
制造工艺	按定制规格精密CNC加工
手柄尺寸	可依客户偏好做人体工学适配